(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-351778 (P2001-351778A)

(43)公開日 平成13年12月21日(2001.12.21)

(51) Int.Cl. ⁷	識別	ll記号 FI			テーマコード(参考)
H 0 5 B	33/06	Н0	5 B 33/0	6	3K007
	33/10		33/1	0	
	33/14		33/1	4 A	

審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 5 頁)

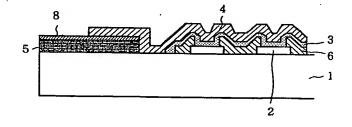
		田工印码	が明め、明からの数U OL (主 U 具)
(21)出願番号	特願2000-171946(P2000-171946)	(71)出願人	000221926
			東北バイオニア株式会社
(22)出願日	平成12年6月8日(2000.6.8)]	山形県天童市大字久野本字日光1105番地
	•	(72)発明者	白幡 邦彦
			山形県米沢市八幡原四丁目3146番7号 東
			北パイオニア株式会社内
		(72)発明者	永山 健一
	·		山形県米沢市八幡原四丁目3146番7号 東
	•	•	北パイオニア株式会社内
		(74)代理人	100092392
			弁理士 小倉 亘
		Fターム(参	考) 3K007 AB06 AB14 AB15 AB18 CA01
			CB01 CC05 DA01 DB03 EB00
			FA01 FA02

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示デバイス及びその製造方法

(57) 【要約】

【目的】 引出し電極5の表層にバリア層8を形成することにより、接触抵抗を上昇させる変質層7の生成を防止し、比較的定電圧で駆動可能な有機エレクトロルミネッセンス表示デバイスを得る。

【構成】 この有機エレクトロルミネッセンス表示デバイスは、透明基板1に設けられた引出し電極5の表層にパリア層8を形成している。引出し電極5は、有機発光層3を介して透明基板1上に積層された金属電極4にバリア層8を介して接触している。引出し電極5は、Cr, Al, Cu, Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Mo, Ta, Ti, W, C, Fe, In, Ag-Mg, Zn等の金属質導電材料で形成される。パリア層8は、耐熱変質性の良好な高融点金属、貴金属、酸化物、窒化物又は酸窒化物で形成される。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板に設けられた引出し電極の表層 にバリア層を形成し、有機発光層を介して透明基板上に 積層された金属電極に、前記バリア層を介して前記引出 し電極が接触していることを特徴とする有機エレクトロ ルミネッセンス表示デバイス。

1

【請求項2】 Cr, Al, Cu, Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Mo, Ta, Ti, W, C, Fe, In, Ag-Mg, Znから選ばれた金属質導電材料で引出し電極が形成されている請求項1記載の有機エレクトロル 10ミネッセンス表示デバイス。

【請求項3】 耐熱変質性の良好な高融点金属, 貴金属, 酸化物, 窒化物又は酸窒化物でパリア層が形成されている請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス表示デバイス。

【請求項4】 引出し電極用金属質導電材料の酸化物, 窒化物又は酸窒化物の薄層としてバリア層が形成されて いる請求項1記載の有機エレクトロルミネッセンス表示 デバイス。

【請求項5】 引出し電極用金属質導電材料の酸化物, 窒化物又は酸窒化物の薄層を密着性改善層として介在さ せて引出し電極が透明基板上に形成されている請求項1 記載の有機エレクトロルミネッセンス表示デバイス。

【請求項6】 バリア層及び密着性改善層を含む引出し 電極を同じエッチング液で加工することを特徴とする有 機エレクトロルミネッセンス表示デバイスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電極に対する接触抵抗 を低く維持し、比較的低い電圧で駆動可能な有機エレク 30 トロルミネッセンス表示デバイスに関する。

[0002]

【従来の技術】ブラウン管に代わるカラー表示装置として、液晶ディスプレイパネルが多方面で普及している。しかし、液晶ディスプレイパネルは、バックライトから液晶層を通過した光で画像表示する方式であるため、見る角度や周囲の明暗度によって画像が見難くなることがある。この点、面発光によって必要画像を表示するエレクトロルミネッセンス素子を用いたディスプレイパネルは、画像の見易さが観察角度によって変わることなく、暗所でも十分な鲜明度で画像が観察される。

【0003】エレクトロルミネッセンス材料として種々の無機材料及び有機材料が知られているが、低電力で高輝度発光する有機材料が注目されている。有機発光材料を使用した表示デバイスは、透明基板1に複数のストライプ状透明電極2、有機発光層3、透明電極2に直交する複数のストライプ状金属電極4を順次積層した構造

(図1)をもっている。透明基板1の上には、金属電極4に導通する引出し電極5が積層されている。

【0004】透明電極2及び金属電極4で形成されるX 50

Yマトリックス上の所定位置に駆動電流を供給すると、 陽極側からのホールと陰極側からの電子が有機発光層 3 で再結合し、有機発光体分子が励起され面状に発光す る。発光は、透明電極 2 及び透明基板 1 を通して外部に 取り出される。本出願人は、この有機エレクトロルミネ ッセンス表示デバイスにおいて層間絶縁膜 6 を形成する とき、透明電極 2 エッジ部の段差に起因する透明電極 2 と金属電極 4 との短絡が防止され、鮮明な画像が表示さ れることを特開平 8 - 3 1 5 9 8 1 号公報で紹介した。 【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】層間絶縁膜6は、たとえばシリカ分散ペーストを所定パターンで塗布し、ベークによって形成される。或いは、ポリイミド系塗料を塗布して、熱処理で架橋させることにより安定なポリマー皮膜として形成される。何れの場合も、層間絶縁膜6の形成にベークを必要とし、引出し電極5の表面を変質させやすい。引出し電極5の材料としては抵抗値が低い金属が使用されているが、ベークによって表面に変質層7(図2)が生成すると、金属電極4との接触抵抗Rが増加する。その結果、有機エレクトロルミネッセンス表示デバイスの駆動に高い電圧が必要となり、また昇温による有機エレクトロルミネッセンス表示デバイスの劣化も促進される。

[0006]

20

【課題を解決するための手段】本発明は、このような問題を解消すべく案出されたものであり、引出し電極の表面にバリア層を形成することにより、ベーク等の加熱時に引出し電極の変質、ひいては引出し電極と金属電極との接触抵抗の上昇を防止し、比較的低い電圧で駆動可能な有機エレクトロルミネッセンス表示デバイスを提供することを目的とする。本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示デバイスは、その目的を達成するため、透明基板に設けられた引出し電極の表層にバリア層を形成し、有機発光層を介して透明基板上に積層された金属電極に、前記バリア層を介して前記引出し電極が接触していることを特徴とする。

【0007】引出し電極は、たとえばCr, Al, Cu, Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Mo, Ta, Ti, W, C, Fe, In, Ag-Mg, 2nから選ばれた金属質導電材料で形成される。パリア層は、耐熱変質性の良好な高融点金属, 貴金属, 酸化物, 窒化物又は酸窒化物で形成される。また、引出し電極用金属質導電材料の酸化物, 窒化物又は酸窒化物の薄層としてもパリア層を形成できる。更に、引出し電極用金属質導電材料の酸化物, 窒化物又は酸窒化物の薄層を密着性改善層として形成した後で、引出し電極を透明基板上に形成してもよい。引出し電極の表層に形成されるパリア層は、密着性改善層を含む引出し電極と共に同じエッチング液を用いて加工することができる。

[0008]

【実施の形態】本発明に従った有機エレクトロルミネッ センス表示デバイスは、たとえば図3に示すように、引 出し電極5の表面をバリア層8で被覆している。その他 は、従来の有機エレクトロルミネッセンス表示デバイス (図1) とほぼ同じ層構造をもっている。バリア層8の 形成によって、層間絶縁膜6形成時に引出し電極5の表 面が熱的に保護され、変質層7の生成が防止される。引 出し電極5の材料には、たとえば抵抗値の低いCr,A I, Cu, Ag, Au, Pt, Pd, Ni, Mo, T a, Ti, W, C, Fe, In, Ag-Mg, Zn等の 10 金属又は合金が使用される。これらの金属又は合金は、 蒸着、スパッタリング、イオンプレーティング等の方法 により薄膜として透明基板1上に形成される。

【0009】パリア層8の材料としては、層間絶縁膜6 形成時のベーク等、熱処理の際に変質しない高融点金 属, 貴金属, 酸化物, 窒化物, 酸窒化物等が適してい る。導電性を妨げない程度の膜厚(具体的には10~1 00Å, 好ましくは10~500Å, 最適には10~2 00Å)でパリア層8を形成する場合、絶縁物に分類さ れている材料でも使用可能である。具体的には、耐変質 20 性に優れたAu, Pt, Pd, W, Mo等の金属材料の 他に、CrOs, AlOs, MoOs, FeOs, Ni O_s, AgO_s, ZnO_s, TaO_s, WO_s, SiO_s, S nO₁, CrN₁, SiN₁, CrN₁O₂, TiC₃, Ta SnO_x, TaSnO_xN_y等の酸化物, 窒化物, 酸窒化 物等がある。

【0010】また、引出し電極5に使用する金属又は合 金の酸化物、窒化物又は酸窒化物をパリア層8に使用す ることも可能である。この場合、たとえば引出し電極5 を成膜する最終段階で、雰囲気に酸素及び/又は窒素を 30 導入することにより金属酸化物、金属窒化物、金属酸窒 化物等のパリア層8が引出し電極5上に形成される。引 出し電極5と同じ金属の酸化物,窒化物又は酸窒化物で 形成されたパリア層8は、引出し電極5と同じエッチン グ液を用いてパターニングできる場合も多い。引出し電 極5の表層に形成されたパリア層8は、層間絶縁膜6を 形成するペーク処理時に変質層7の生成を防止する上で 有効であるが、ペーク処理時に限らず他の熱処理工程に おいても変質層7の生成を有効に抑制し、金属電極4に 対する引出し電極5の接触抵抗を低位に維持する。

【0011】更に、引出し電極5の形成に先立って、酸 素を導入したAr雰囲気でたとえばCrをスパッタリン グすると、CrO.質の薄膜が透明基板1上に形成され る。Cr〇、質薄膜は、基板1に対する引出し電極5の 密着性を向上させる密着性改善層9(図5)として働 く。Cr〇、質薄膜も、引出し電極5と同じエッチング 液を用いてパターニングできる。

[0012]

【実施例1】透明基板1に透明電極2を形成した後、A r 雰囲気でCrをターゲットに用いたスパッタリングに 50

よって膜厚2900点の純Cr薄膜を形成した(図4 a)。次いで、Ar雰囲気に酸素を導入し、CrOxを 引出し電極5の上に堆積させ、膜厚100点のCrO、 薄膜を形成した(図4b)。СгО,薄膜が形成された 後の透明基板1にレジストパターンを形成した後、硝酸 セリウムアンモンを含むエッチング液を用いてエッチン グし、レジストを剥離することによって純Cr薄膜及び CrO、薄膜をパターニングして所定形状の引出し電極 5及びパリア層8を形成した(図4c)。このとき、同 じエッチング液で引出し電極5及びパリア層8の双方を パターニングできるため、簡便な工程で所定形状の引出 し電極5及びパリア層8が作成できる。

【0013】次いで、透明基板1をオーブンに装入して 150~300℃の範囲でペークした後、A1を蒸着す るリフトオフ法で金属電極4を形成した(図4d)。形 成された金属電極4と引出し電極5との接触抵抗Rを測 定した結果を表1に示す。表1から明らかなように、C rOiをパリア層8として形成した引出し電極5では、 ベーク後にも金属電極4に対して低い接触抵抗を維持し ており、ペーク温度200℃以上でほぼ一定した低接触 抵抗を示した。

[0014]

【実施例2】透明基板1に対する引出し電極5の密着性 を向上させるため、酸素を導入したAr雰囲気でCrを ターゲットにしたスパッタリングによって膜厚100Å のC r 〇,薄膜(密着性改善層9)を透明基板1上に形 成した(図5a)。次いで、酸素フリーのAr雰囲気に 代えてCrをスパッタリングし、膜厚2800ÅのCr 薄膜(引出し電極5)を堆積させ(図5b)、再び酸素 をAr雰囲気に導入してスパッタリングし、膜厚100 AのCrOx薄膜(パリア層8)を金属電極4の上に形 成した (図5 c)。各薄膜を実施例1と同じエッチング 方法でパターニングし、下層に密着性改善層9,表層に パリア層8を備えた引出し電極5を形成した(図5 d)。次いで、透明基板1をオーブンに装入して150 ~300℃の範囲でペークした後、A1を蒸着するリフ トオフ法で金属電極4を形成した(図5 e)。

【0015】密着性改善層9及びパリア層8のCrO。 薄膜で挟持された引出し電極5の金属電極4に対する接 触抵抗Rを測定した結果を表1に示す。この場合にも、 ベーク温度に拘わらず低い接触抵抗が維持された。ま た、基板/Cr薄膜及び基板/CrOx薄膜/Cr薄膜 を碁盤目密着試験に供して密着性を調査したところ、そ れぞれ75/100及び100/100の試験結果が得 られ、CrOx 薄膜を介在させることによって基板1に 対する引出し電極5の密着性が向上することが判った。

[0016]

【比較例】バリア層8及び密着性改善層9を形成しない ことを除き、実施例1と同じ方法で引出し電極5を透明 基板1の上に形成した後、金属電極4を堆積させた。形

成された引出し電極5の金属電極4に対する接触抵抗R を測定したところ、表1にみられるようにベークにより 接触抵抗が増加し、なかでも250℃を超えるベーク温 度では接触抵抗の増加が著しかった。接触抵抗の著しい* *増加は、引出し電極5の表面に変質層7が生成した結果 であり、駆動時に有機エレクトロルミネッセンス表示デ バイスを昇温させる原因にもなる。

[0017]

表1: C r 引出し電極の層構成及びベーク温度が金属電極との接触抵抗 (Ω) に及ぼす影響

引出し電極	ベ ー ク 温 度 (℃)						
の層構造	20	150	200	250	300	350	
Cr/CrOx	2.8×10 ³	3.9×10^3	8.6 × 10 ¹	2.5 × 10 ¹	1.7×10 ¹	8.0×10 ¹	
CrOx / Cr / CrOx	2.9×10 ³	3.3×10 ¹	8.7×10 ¹	2.5 × 10 ¹	1.7×10 ¹	7.9×10 ¹	
バリア層なし	6.2×10 ¹	2.3×10^{2}	1.1×10 ²	6.3×10 ²	4.8×10 ³	2.8×10 ⁵	

[0018]

【発明の効果】以上に説明したように、本発明の有機工 レクトロルミネッセンス表示デバイスは、透明基板の上 に設けられる引出し電極の表層にパリア層を形成してい るので、層間絶縁膜形成時等の際に加熱されても引出し 20 電極の表面に変質層が生じることがない。したがって、 引出し電極と金属電極との接触抵抗が低く維持され、比 較的低い電圧で駆動することが可能な有機エレクトロル ミネッセンス表示デバイスとなる。また、密着性改善層 を介して引出し電極を形成するとき、透明基板に対する 引出し電極の密着性が向上し、引出し電極と金属電極と の良好な導通状態が維持される。

【図面の簡単な説明】

【図1】 層間絶縁膜を設けた有機エレクトロルミネッ※

※センス表示デバイスの層構造を示す断面図

引出し電極の表面に生成した変質層により接 【図2】 触抵抗が上昇することを説明する図

【図3】 本発明に従ってバリア層を形成した有機エレ クトロルミネッセンス表示デバイスの層構造を示す断面

【図4】 実施例1の有機エレクトロルミネッセンス表 示デバイスを作製する工程図

実施例2の有機エレクトロルミネッセンス表 示デバイスを作製する工程図

【符号の説明】

1:透明基板 2:透明電極 3:有機発光層

4:金属電極

30

5:引出し電極

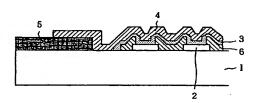
6:層間絶縁膜

7:変質層

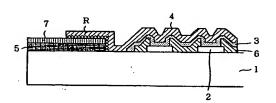
8:バリア層

9:密着性改善層

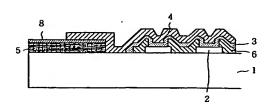
[図1]



【図2】

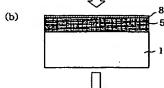


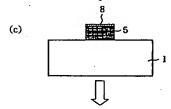
【図3】

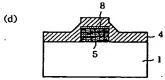


[図4]









【図5】

